

УДК 517.958:537.311.1;621.315.592

Н. А. ПОКЛОНСКИЙ, А. И. КОВАЛЕВ, С. А. ВЫРКО

**ДРЕЙФ И ДИФфуЗИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ПО ДВУХУРОВНЕВЫМ (ТРЕХЗАРЯДНЫМ) ТОЧЕЧНЫМ ДЕФЕКТАМ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ**

(Представлено академиком Н. М. Олехновичем)

Белорусский государственный университет, Минск

Поступило 07.05.2014

**Введение.** Актуальность исследования прыжковой миграции электронов между двухуровневыми точечными дефектами одного сорта (вида) с тремя зарядовыми состояниями ( $-1$ ,  $0$ ,  $+1$ ) в запрещенной энергетической зоне (энергетической щели) кристаллического полупроводника связана с возможностью (отмеченной в [1; 2]) формирования на таких дефектах аналога  $pn$ -перехода (так называемого  $\zeta$ -перехода). В частности, на основе  $\zeta$ -перехода предлагается создать выпрямитель прыжкового электрического тока. Поэтому представляет практический интерес определение условий, при которых ток, обусловленный прыжками электронов по дефектам, превагирует над током, обусловленным электронами  $c$ -зоны и/или дырками  $v$ -зоны полупроводника, для температур вплоть до комнатных и выше (см., напр., [3]).

Для создания большой концентрации дефектов с локальными уровнями энергии используется воздействие на полупроводник ионизирующего излучения (радиации) с последующим частичным термическим отжигом [4]. Введение в полупроводник точечных двухуровневых трехзарядных радиационных дефектов (или  $r$ -дефектов) приводит к стабилизации уровня Ферми в окрестности середины запрещенной зоны ряда кристаллических полупроводниковых материалов [5]. Энергетические уровни  $r$ -дефектов (далее просто дефектов) образуют в энергетической щели полупроводника две энергетические зоны ( $\{1\}$ -зону и  $\{2\}$ -зону, а каждый из дефектов может находиться в одном из трех зарядовых состояний [2; 6; 7]. Для определенности примем, что энергетические уровни дефектов в зарядовых состояниях  $(0)$  и  $(+1)$  формируют  $\{1\}$ -зону шириной  $W_1$ , а дефекты в зарядовых состояниях  $(-1)$  и  $(0)$  формируют  $\{2\}$ -зону шириной  $W_2$ . В частном случае [2] классических  $\{1\}$ - и  $\{2\}$ -зон их ширины (разброс энергетических уровней дефектов) из-за кулоновского взаимодействия ближайших ионов много больше квантового уширения их уровней, обусловленного конечностью времени локализации на дефектах электронов.

Цель работы – получить аналитические выражения для длины экранирования внешнего стационарного электрического поля и длины прыжковой диффузии электронов в таких полупроводниках.

**Система уравнений дрейфово-диффузионной модели.** Описание прыжковой миграции электронов по точечным дефектам в кристаллическом полупроводнике в рамках дрейфово-диффузионной модели включает: 1) уравнение для плотности электрического тока, состоящего из дрейфовой компоненты (движение электронов под действием электрического поля) и диффузионной компоненты (движение электронов вследствие градиента концентрации зарядовых состояний неподвижных дефектов); 2) уравнение Пуассона, связывающее дивергенцию напряженности электрического поля с плотностью нескомпенсированного электрического заряда внутри полупроводника; 3) уравнение непрерывности для концентрации подвижных зарядовых состояний неподвижных атомных дефектов кристаллической решетки [1; 2; 6; 8–11].

Рассмотрим полупроводник, содержащий равномерно (однородно) распределенные неподвижные точечные двухуровневые дефекты одного сорта с тремя зарядовыми состояниями  $Z = -1, 0, +1$  и суммарной концентрацией  $N = N_0 + N_{-1} + N_{+1}$ , где  $N_Z$  – концентрация дефектов в  $Z$ -м зарядовом

состоянии (далее в  $Z$ -состоянии на фоне электрически нейтральной кристаллической матрицы). В полупроводнике содержатся также полностью ионизированные водородоподобные доноры и акцепторы с концентрациями  $N_d = K_d N$  и  $N_a = K_a N$ , где  $0 < K_a < 1$ ,  $0 < K_d < 1$ . Условие электрической нейтральности кристаллического полупроводника имеет вид:  $N_{-1} = N_{+1} + (K_d - K_a)N$ . Все доноры находятся в зарядовом состоянии (+1), а все акцепторы – в зарядовом состоянии (-1), поэтому они в прыжковой миграции зарядов напрямую не участвуют. При прыжке одного электрона между двумя электрически нейтральными дефектами один дефект переходит в зарядовое состояние (-1), а другой – в зарядовое состояние (+1). Если прыжок одного электрона происходит между двумя дефектами, которые находятся в зарядовых состояниях (-1) и (+1), то происходит «рекомбинация» их зарядовых состояний, и эти два дефекта становятся электрически нейтральными. Прыжок одиночного электрона возможен с дефекта в зарядовом состоянии (-1) на дефект в зарядовом состоянии (0), а также с дефекта в зарядовом состоянии (0) на дефект в зарядовом состоянии (+1), т. е. возможны одноэлектронные переходы (-1) → (0) и (0) → (+1). Прыжки пар электронов (иначе биполяронов [12; 13]) между дефектами в зарядовых состояниях (-1) и (+1) соответствуют переходам (-1) → (+1). Считается, что прыжки одиночного электрона с дефекта в зарядовом состоянии (0) на дефект в зарядовом состоянии (-1), а также с состояния (+1) на состояние (0) не реализуются. Принимается, что среднее время «оседлой» жизни электронов на дефектах много больше средней длительности их прыжка между неподвижными дефектами. Разности темпов прыжковых переходов одиночных электронов и биполяронов между неподвижными дефектами против и по направлению напряженности внешнего электрического поля, а также градиенты концентраций зарядовых состояний дефектов обуславливают суммарный прыжковый ток.

Пусть к находящемуся в термостате однородному кристаллическому полупроводнику с рассматриваемыми точечными дефектами приложено внешнее электрическое поле, направленное вдоль оси  $x$ . Запишем выражение для плотности прыжкового тока, когда при наложении на полупроводник внешнего электрического поля все физические величины зависят только от одной пространственной координаты  $x$ , т. е. когда изменение зарядового состояния системы дефектов происходит только в направлении одной оси координат (одномерное приближение). Считаем, что средние длины прыжков как одиночных электронов, так и пар электронов (биполяронов) много меньше характерных размеров неоднородностей распределения дефектов. В этом приближении плотность прыжкового тока  $J_{Z,Z'}$  между дефектами в зарядовых состояниях  $Z$  и  $Z'$  включает дрейфовую и диффузионную составляющие [1; 2; 6]:

$$J_{Z,Z'}(x, t) = |Z - Z'| e N_{Z,Z'}(x, t) \left[ M_{Z,Z'} E(x, t) + D_{Z,Z'} \frac{\partial}{\partial x} \ln \frac{N_Z(x, t)}{N_{Z'}(x, t)} \right], \quad (1)$$

где  $x$  – координата;  $t$  – время;  $e$  – элементарный заряд ( $-e < 0$  – заряд электрона);  $E(x, t)$  – напряженность электрического поля внутри полупроводника;  $Z, Z' = -1, 0, +1$  – зарядовые состояния дефектов;  $N_Z(x, t) = N_Z + \delta N_Z(x, t)$  – зависящая от  $x$  и  $t$  неравновесная концентрация дефектов в  $Z$ -состоянии;  $N_Z$  – равновесное (в отсутствие тока) значение концентрации дефектов в  $Z$ -состоянии,  $N_{Z,Z'}(x, t) = N_Z(x, t) N_{Z'}(x, t) / N$  – эффективная концентрация одиночных электронов, прыгающих из  $Z$ -состояний в  $Z'$ -состояния дефектов (для  $Z < Z'$  при  $|Z - Z'| = 1$ ) или биполяронов (для  $Z < Z'$  при  $|Z - Z'| = 2$ );  $M_{Z,Z'}$  и  $D_{Z,Z'}$  – дрейфовая подвижность и коэффициент диффузии одиночных электронов и биполяронов, прыгающих из  $Z$ -состояний в  $Z'$ -состояния дефектов; считается, что  $M_{Z,Z'}$  и  $D_{Z,Z'}$  слабее по сравнению с  $N_{Z,Z'}(x, t)$  зависят от  $x$  и  $t$ .

Отметим, что дрейфово-диффузионное приближение справедливо и для переменного прыжкового тока, если частота синусоидального электрического поля много меньше средней частоты прыжков электронов между дефектами. В частности, из (1) следует прыжковая электропроводность на постоянном токе

$$\sigma_{Z,Z'} = |Z - Z'| e N_{Z,Z'} M_{Z,Z'}, \quad (2)$$

где  $N_{Z,Z'}$  – равновесная концентрация прыгающих одиночных электронов (для  $Z < Z'$  при  $|Z - Z'| = 1$ ) или биполяронов (для  $Z < Z'$  при  $|Z - Z'| = 2$ ).

Отношение коэффициента диффузии  $D_{Z,Z'}$  к дрейфовой подвижности  $M_{Z,Z'}$  прыгающих между дефектами электронов дается для  $Z \neq Z'$  соотношением типа Нернста–Эйнштейна (см., напр., [6; 8; 10]):

$$\frac{D_{Z,Z'}}{M_{Z,Z'}} = \xi_{Z,Z'} \frac{k_B T}{|Z - Z'| e}, \quad (3)$$

где  $\xi_{Z,Z'} \geq 1$  – безразмерный параметр (определяется отношением разброса энергетических уровней дефектов, т. е. отношением ширины  $\{1\}$ - и  $\{2\}$ -зон  $W_1$  и  $W_2$  к тепловой энергии  $k_B T$  (здесь  $k_B$  – постоянная Больцмана;  $T$  – термодинамическая температура). Если  $W_1 + W_2 \ll k_B T$ , то  $\xi_{Z,Z'} \rightarrow 1$ .

Прыжковой миграции электронов в кристаллическом полупроводнике, содержащем дефекты в трех зарядовых состояниях  $(-1, 0, +1)$ , соответствуют переходы  $(-1) \rightarrow (0)$  и  $(0) \rightarrow (+1)$  при прыжках одиночных электронов и переходы  $(-1) \rightarrow (+1)$  – при прыжках биполяронов между дефектами. Тогда из (1) получим выражения для трех составляющих полной плотности прыжкового тока  $J_{\text{tot}}(x, t) = J_{-1,0}(x, t) + J_{0,+1}(x, t) + J_{-1,+1}(x, t)$  в виде

$$\begin{aligned} J_{-1,0}(x, t) &= e N_{-1,0}(x, t) \left[ M_{-1,0} E(x, t) + D_{-1,0} \frac{\partial}{\partial x} \ln \frac{N_{-1}(x, t)}{N_0(x, t)} \right], \\ J_{0,+1}(x, t) &= e N_{0,+1}(x, t) \left[ M_{0,+1} E(x, t) + D_{0,+1} \frac{\partial}{\partial x} \ln \frac{N_0(x, t)}{N_{+1}(x, t)} \right], \\ J_{-1,+1}(x, t) &= 2e N_{-1,+1}(x, t) \left[ M_{-1,+1} E(x, t) + D_{-1,+1} \frac{\partial}{\partial x} \ln \frac{N_{-1}(x, t)}{N_{+1}(x, t)} \right], \end{aligned} \quad (4)$$

где  $N_{-1,0} = N_{-1} N_0 / N$  – концентрация одиночных электронов, прыгающих между дефектами в зарядовых состояниях  $(-1)$  и  $(0)$ ;  $N_{0,+1} = N_0 N_{+1} / N$  – концентрация одиночных электронов, прыгающих между дефектами в зарядовых состояниях  $(0)$  и  $(+1)$ ;  $N_{-1,+1} = N_{-1} N_{+1} / N$  – концентрация биполяронов (с зарядом  $-2e$ ), прыгающих между дефектами в зарядовых состояниях  $(-1)$  и  $(+1)$ .

Если дрейфовые и диффузионные компоненты плотностей стационарных прыжковых токов скомпенсированы ( $J_{-1,0}(x) = J_{0,+1}(x) = J_{-1,+1}(x) = 0$ ), но стационарная напряженность электрического поля  $E(x) \neq 0$ , то из (4) с учетом (3) следует соотношение

$$\xi_{-1,+1} = 2 \frac{\xi_{-1,0} \xi_{0,+1}}{\xi_{-1,0} + \xi_{0,+1}}.$$

Напряженность электрического поля  $E(x, t)$  внутри полупроводника удовлетворяет уравнению Пуассона (см., напр., [2; 6; 14])

$$\frac{\partial E(x, t)}{\partial x} = \frac{\rho[\varphi(x, t)]}{\varepsilon} = \frac{e}{\varepsilon} [\delta N_{+1}(x, t) - \delta N_{-1}(x, t)], \quad (5)$$

где  $\rho[\varphi(x, t)]$  – объемная плотность заряда;  $\varphi(x, t)$  – потенциал электрического поля (зависящий от координаты  $x$  и от времени  $t$ );  $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$  – статическая диэлектрическая проницаемость;  $\varepsilon_r$  – относительная диэлектрическая проницаемость;  $\varepsilon_0$  – электрическая постоянная. Неравновесная концентрация дефектов  $N_Z(x, t)$  в  $Z$ -состоянии может быть представлена как  $N_Z(x, t) = N_Z + \delta N_Z(x, t)$ , где  $N_Z$  – термодинамически равновесное значение концентрации;  $\delta N_Z(x, t)$  – отклонение от  $N_Z$  при  $E(x, t) \neq 0$ . Заметим, что внешнее электрическое поле определяет решение уравнения (5) через граничные и начальные условия.

Уравнения непрерывности для мигрирующих по кристаллу вдоль оси  $x$  трех зарядовых состояний  $(-1, 0, +1)$  неподвижных точечных дефектов можно представить в виде [2; 6]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial N_{-1}(x, t)}{\partial t} &= -\alpha N_{-1}(x, t) N_{+1}(x, t) + \beta N_0^2(x, t) + \frac{1}{e} \frac{\partial J_{-1,0}(x, t)}{\partial x}, \\ \frac{\partial N_0(x, t)}{\partial t} &= 2[\alpha N_{-1}(x, t) N_{+1}(x, t) - \beta N_0^2(x, t)] + \frac{1}{e} \frac{\partial}{\partial x} [J_{0,+1}(x, t) - J_{-1,0}(x, t)], \\ \frac{\partial N_{+1}(x, t)}{\partial t} &= -\alpha N_{-1}(x, t) N_{+1}(x, t) + \beta N_0^2(x, t) - \frac{1}{e} \frac{\partial J_{0,+1}(x, t)}{\partial x}, \end{aligned} \quad (6)$$

где  $\alpha$  – коэффициент «прыжкового захвата» одного электрона с дефекта в зарядовом состоянии  $(-1)$  на дефект в зарядовом состоянии  $(+1)$ , заканчивающегося появлением двух электрически нейтральных дефектов  $[(-1) + (+1) \rightarrow 2(0)]$ ;  $\beta$  – коэффициент тепловой ионизации двух электрически нейтральных дефектов  $[2(0) \rightarrow (+1) + (-1)]$ . При записи (6) учтено, что  $\partial N / \partial t = \partial N_{-1} / \partial t + \partial N_0 / \partial t + \partial N_{+1} / \partial t = 0$ . Принято также, что  $\partial J_{-1,+1}(x, t) / \partial x = 0$ , так как прыжки биполяронов не вызывают изменения во времени концентрации дефектов ни в зарядовых состояниях  $(-1)$ , ни в зарядовых состояниях  $(+1)$ .

**Стационарное состояние системы прыгающих по дефектам электронов.** В стационарном случае во всех уравнениях исчезает зависимость от времени и производные по пространственной координате становятся полными (подразумевается зависимость только от координаты  $x$ ). Учитывая, что суммарная концентрация дефектов одного сорта в трех зарядовых состояниях  $(N_{-1} + N_0 + N_{+1} = N)$  не зависит от координаты, получаем

$$\frac{dN_{-1}}{dx} + \frac{dN_0}{dx} + \frac{dN_{+1}}{dx} = 0. \quad (7)$$

В стационарном состоянии уравнения непрерывности (6) принимают вид

$$\begin{aligned} \frac{dJ_{-1,0}(x)}{dx} &= e[\alpha N_{-1}(x)N_{+1}(x) - \beta N_0^2(x)], \\ \frac{d}{dx}[J_{0,+1}(x) - J_{-1,0}(x)] &= 2e[-\alpha N_{-1}(x)N_{+1}(x) + \beta N_0^2(x)], \\ \frac{dJ_{0,+1}(x)}{dx} &= e[-\alpha N_{-1}(x)N_{+1}(x) + \beta N_0^2(x)]. \end{aligned} \quad (8)$$

Из (8) видно, что  $dJ_{-1,0} / dx + dJ_{0,+1} / dx = 0$ . Известно (см., напр., [14]), что в стационарном случае дивергенция плотности полного прыжкового тока  $J_{\text{tot}}(x) = J_{-1,0}(x) + J_{0,+1}(x) + J_{-1,+1}(x)$  равна нулю ( $dJ_{\text{tot}} / dx = 0$ ). Как следствие, дивергенция плотности прыжкового тока  $J_{-1,+1}$  биполяронов между дефектами в зарядовых состояниях  $(-1)$  и  $(+1)$  в стационарном состоянии тоже равна нулю ( $dJ_{-1,+1} / dx = 0$ ). Итак, плотность постоянного (стационарного) прыжкового тока в полупроводнике не зависит от координаты, т. е.  $J_{\text{tot}} = \text{const}$ , но  $J_{-1,0} = J_{-1,0}(x)$ ,  $J_{0,+1} = J_{0,+1}(x)$  и  $J_{-1,+1} = \text{const}$ .

При возмущении полупроводника внешним стационарным электрическим полем концентрация дефектов в  $Z$ -состоянии  $N_Z(x) = N_Z + \delta N_Z(x)$ , где  $\delta N_Z(x)$  – отклонение концентрации  $N_Z(x)$  от равновесного значения  $N_Z$  в результате действия поля на темп прыжков как одиночных электронов, так и на темп прыжков биполяронов между дефектами против и по направлению напряженности поля;  $\delta N_{-1}(x) + \delta N_0(x) + \delta N_{+1}(x) = 0$ . Далее, по аналогии с рассмотрением дрейфа и диффузии электронов  $c$ -зоны и дырок  $v$ -зоны (см., напр., [14]), зависимостью дрейфовой прыжковой подвижности  $M_{Z,Z'}$  и коэффициента прыжковой диффузии  $D_{Z,Z'}$  от координаты  $x$  по сравнению с зависимостью концентрации прыгающих по дефектам одиночных электронов (и биполяронов)  $N_{Z,Z'}(x)$  от  $x$  пренебрегаем.

Итак, в диффузионно-дрейфовом приближении прыжковая миграция электронов по дефектам при наложении на полупроводник внешнего стационарного электрического поля описывается, с учетом выражений (4), (5), (7) и (8), системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} \frac{dN_{-1}(x)}{dx} &= - \frac{eN_{-1}(x)[N_0(x)\xi_{0,+1} + N_{+1}(x)(\xi_{-1,0} + \xi_{0,+1})]}{Nk_B T \xi_{-1,0} \xi_{0,+1}} E(x) + \\ &\quad \frac{N_0(x) + N_{+1}(x)}{eN_0(x)D_{-1,0}} J_{-1,0}(x) + \frac{N_{-1}(x)}{eN_0(x)D_{0,+1}} J_{0,+1}(x), \\ \frac{dN_{+1}(x)}{dx} &= \frac{eN_{+1}(x)[N_0(x)\xi_{-1,0} + N_{-1}(x)(\xi_{-1,0} + \xi_{0,+1})]}{Nk_B T \xi_{-1,0} \xi_{0,+1}} E(x) - \\ &\quad \frac{N_0(x) + N_{-1}(x)}{eN_0(x)D_{0,+1}} J_{0,+1}(x) - \frac{N_{+1}(x)}{eN_0(x)D_{-1,0}} J_{-1,0}(x), \\ \frac{dE(x)}{dx} &= \frac{e}{\varepsilon} [\delta N_{+1}(x) - \delta N_{-1}(x)], \\ \frac{dJ_{-1,0}(x)}{dx} &= e[\alpha N_{-1}(x)N_{+1}(x) - \beta N_0^2(x)], \\ \frac{dJ_{0,+1}(x)}{dx} &= e[-\alpha N_{-1}(x)N_{+1}(x) + \beta N_0^2(x)]. \end{aligned} \quad (9)$$

При малом возмущении равновесного состояния ( $\delta N_{-1} / N_{-1} \ll 1$ ,  $\delta N_0 / N_0 \ll 1$ ,  $\delta N_{+1} / N_{+1} \ll 1$ ,  $E, J_{-1,0}, J_{0,+1}$ ) прыгающих между дефектами электронов, систему уравнений (9) можно линеаризовать (по общей схеме [15]) относительно пяти переменных ( $\delta N_{-1}, \delta N_{+1}, E, J_{-1,0}, J_{0,+1}$ ):

$$\begin{aligned} \frac{d[\delta N_{-1}(x)]}{dx} &= -\frac{eN_{-1}[N_0\xi_{0,+1} + N_{+1}(\xi_{-1,0} + \xi_{0,+1})]}{Nk_B T \xi_{-1,0} \xi_{0,+1}} E(x) + \\ &\quad \frac{N_0 + N_{+1}}{eN_0 D_{-1,0}} J_{-1,0}(x) + \frac{N_{-1}}{eN_0 D_{0,+1}} J_{0,+1}(x), \\ \frac{d[\delta N_{+1}(x)]}{dx} &= \frac{eN_{+1}[N_0\xi_{-1,0} + N_{-1}(\xi_{-1,0} + \xi_{0,+1})]}{Nk_B T \xi_{-1,0} \xi_{0,+1}} E(x) - \\ &\quad \frac{N_0 + N_{-1}}{eN_0 D_{0,+1}} J_{0,+1}(x) - \frac{N_{+1}}{eN_0 D_{-1,0}} J_{-1,0}(x), \\ \frac{dE(x)}{dx} &= \frac{e}{\varepsilon} [\delta N_{+1}(x) - \delta N_{-1}(x)], \\ \frac{\partial J_{-1,0}(x)}{\partial x} &= e[\alpha N_{-1} + 2\beta N_0] \delta N_{+1}(x) + e[\alpha N_{+1} + 2\beta N_0] \delta N_{-1}(x), \\ \frac{\partial J_{0,+1}(x)}{\partial x} &= -e[\alpha N_{-1} + 2\beta N_0] \delta N_{+1}(x) - e[\alpha N_{+1} + 2\beta N_0] \delta N_{-1}(x). \end{aligned} \quad (10)$$

Линейная система уравнений (10) может быть записана в матричном виде

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} \delta N_{-1} \\ \delta N_{+1} \\ E \\ J_{-1,0} \\ J_{0,+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & 0 & 0 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta N_{-1} \\ \delta N_{+1} \\ E \\ J_{-1,0} \\ J_{0,+1} \end{pmatrix} \equiv M \begin{pmatrix} \delta N_{-1} \\ \delta N_{+1} \\ E \\ J_{-1,0} \\ J_{0,+1} \end{pmatrix}, \quad (11)$$

где  $a_{13} = -\frac{eN_{-1}[N_0\xi_{0,+1} + N_{+1}(\xi_{-1,0} + \xi_{0,+1})]}{Nk_B T \xi_{-1,0} \xi_{0,+1}}$ ;  $a_{14} = \frac{N_0 + N_{+1}}{eN_0 D_{-1,0}}$ ;  $a_{15} = \frac{N_{-1}}{eN_0 D_{0,+1}}$ ;  $a_{23} = \frac{eN_{+1}[N_0\xi_{-1,0} + N_{-1}(\xi_{-1,0} + \xi_{0,+1})]}{Nk_B T \xi_{-1,0} \xi_{0,+1}}$ ;  $a_{24} = -\frac{N_{+1}}{eN_0 D_{-1,0}}$ ;  $a_{25} = -\frac{N_0 + N_{-1}}{eN_0 D_{0,+1}}$ ;  $a_{31} = -a_{32} = -\frac{e}{\varepsilon}$ ;  $a_{41} = -a_{51} = e(\alpha N_{+1} + 2\beta N_0)$ ;  $a_{42} = -a_{52} = e(\alpha N_{-1} + 2\beta N_0)$ .

Ограничимся рассмотрением типичной ситуации, когда все корни  $\lambda_i$  ( $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ) характеристического уравнения  $\det[M - \lambda \mathbf{1}] = 0$  (собственные значения матрицы  $M$ ) однократны. Тогда общее решение линейной системы (11) имеет вид

$$\begin{pmatrix} \delta N_{-1} \\ \delta N_{+1} \\ E \\ J_{-1,0} \\ J_{0,+1} \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ A_{14} \\ A_{15} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} A_{21} \\ A_{22} \\ A_{23} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \exp(\lambda_2 x) + C_3 \begin{pmatrix} A_{31} \\ A_{32} \\ A_{33} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \exp(\lambda_3 x) + \\ C_4 \begin{pmatrix} A_{41} \\ A_{42} \\ A_{43} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \exp(\lambda_4 x) + C_5 \begin{pmatrix} A_{51} \\ A_{52} \\ A_{53} \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \exp(\lambda_5 x),$$

где  $C_i$  – константы, которые определяются из граничных условий;  $A_{ij}$  – координаты собственных векторов, которые выражаются через элементы  $a_{ij}$  матрицы  $M$ . [Здесь  $A_{14} = \sigma_{-1,0}$  и  $A_{15} = \sigma_{0,+1}$ , где  $\sigma_{-1,0}$  и  $\sigma_{0,+1}$  определяются по (2). Нулевой корень характеристического уравнения  $\det[M - \lambda \mathbf{1}] = 0$  обозначен  $\lambda_1 = 0$ .]

**Узкие {1}- и {2}-зоны (полосы) уровней энергии дефектов.** В случае, когда ширины {1}- и {2}-зон уровней дефектов  $W_1$  и  $W_2$  меньше тепловой энергии  $k_B T$ , безразмерные параметры  $\xi_{-1,0} = \xi_{0,+1} = \xi_{-1,+1} = 1$  и корни  $\lambda_i$  характеристического уравнения совпадают с решением [6]

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_i = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [\Lambda_s^{-2} + \Lambda_d^{-2} \pm (\Lambda_s^{-2} - \Lambda_d^{-2})]^{1/2}, \quad i = 2, \dots, 5, \quad (12)$$

где  $\Lambda_s^{-2} = \frac{e^2}{\varepsilon k_B T} (N_{-1,0} + N_{0,+1} + 4N_{-1,+1})$ ,  $\Lambda_d^{-2} = \frac{\alpha N (N_{-1} + N_{+1})}{N_0} \frac{D_{-1,0} N_{-1,0} + D_{0,+1} N_{0,+1}}{D_{-1,0} D_{0,+1} (N_{-1,0} + N_{0,+1})}$ .

Из выражения (12) вычисляем:  $\lambda_2 = -1 / \Lambda_s$ ,  $\lambda_3 = 1 / \Lambda_s$ ,  $\lambda_4 = -1 / \Lambda_d$ ,  $\lambda_5 = 1 / \Lambda_d$ . Следуя [6], можно выделить корень  $\lambda_2$ , определяющий длину экранирования внешнего стационарного электрического поля в полупроводнике  $\Lambda_s$ , и корень  $\lambda_4$ , определяющий длину диффузии  $\Lambda_d$  электронов в {1}- и {2}-зонах дефектов. Отметим, что оба корня  $\lambda_2$  и  $\lambda_4$  – отрицательные собственные значения. Видно, что концентрация прыгающих между дефектами в зарядовых состояниях (-1) и (+1) биполяронов (пар электронов)  $N_{-1,+1} = N_{-1}N_{+1} / N$  входит в длину экранирования  $\Lambda_s$ , но не входит в длину диффузии  $\Lambda_d$ , так как  $dJ_{-1,+1} / dx = 0$ . Отметим еще, что, согласно (6), в состоянии термодинамического равновесия  $\alpha N_{-1}N_{+1} = \beta N_0^2$ , поэтому коэффициент  $\beta$ , характеризующий скорость тепловой ионизации электрически нейтральных дефектов, не входит в (12). Заметим наконец, следуя терминологии [16], что если длина экранирования  $\Lambda_s$  больше длины диффузии  $\Lambda_d$ , то полупроводник называется релаксационным, если же  $\Lambda_s$  меньше  $\Lambda_d$ , то – рекомбинационным.

**Широкие {1}- и {2}-зоны (полосы) уровней энергии дефектов.** В случае, когда ширины {1}- и {2}-зон уровней дефектов  $W_1$  и  $W_2$  больше тепловой энергии  $k_B T$ , безразмерные параметры  $\xi_{Z,Z'} > 1$  не равны между собой ( $\xi_{-1,0} \neq \xi_{0,+1} \neq \xi_{-1,+1}$ ).

Решения характеристического уравнения  $\det[M - \lambda \mathbf{1}] = 0$ , т. е. собственные значения  $\lambda_i$  имеют вид

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_i = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} [\Lambda_s^{-2} + \Lambda_d^{-2} \pm \{(\Lambda_s^{-2} + \Lambda_d^{-2})^2 - 4\Lambda_s^{-2}\Lambda_d^{-2}Y_s Y_d\}^{1/2}]^{1/2}, \quad i = 2, \dots, 5, \quad (13)$$

где  $\Lambda_s = \sqrt{\frac{\epsilon k_B T}{e^2(\tilde{N}_{-1,0} + \tilde{N}_{0,+1} + 4\tilde{N}_{-1,+1})}}$  – условная длина экранирования;  $\tilde{N}_{-1,0} = \frac{N_{-1,0}}{\xi_{-1,0}}$ ;  $\tilde{N}_{0,+1} = \frac{N_{0,+1}}{\xi_{0,+1}}$ ;  $\tilde{N}_{-1,+1} = \frac{N_{-1,+1}}{\xi_{-1,+1}}$ ;  $\Lambda_d = \sqrt{D_d \tau_d}$  – условная длина диффузии;  $D_d = \frac{D_{-1,0}D_{0,+1}(N_{-1,0} + N_{0,+1})}{D_{-1,0}N_{-1,0} + D_{0,+1}N_{0,+1}}$  – коэф-

фициент прыжковой диффузии электронов в {1}- и {2}-зонах дефектов;  $\tau_d = \frac{N_0}{\alpha N(N_{-1} + N_{+1})}$  – время жизни двух дефектов в зарядовых состояниях (-1) и (+1) относительно прыжкового перехода между ними одного электрона по схеме (-1) + (+1)  $\rightarrow$  2(0);  $Y_s = \frac{N_{-1,0} + N_{0,+1} + N_{-1,+1}}{\tilde{N}_{-1,0} + \tilde{N}_{0,+1} + \tilde{N}_{-1,+1}}$ ;  $Y_d = \frac{N_{-1}\tilde{D}_{-1,0} + N_{+1}\tilde{D}_{0,+1}}{N_{-1}D_{-1,0} + N_{+1}D_{0,+1}}$ ;  $\tilde{D}_{-1,0} = \frac{D_{-1,0}}{\xi_{-1,0}}$ ;  $\tilde{D}_{0,+1} = \frac{D_{0,+1}}{\xi_{0,+1}}$ ;  $Y_s \geq 1$ ;  $0 < Y_d \leq 1$ ;  $Y_s Y_d > 0$ ;  $\xi_{-1,0} \geq 1$ ;  $\xi_{0,+1} \geq 1$ ;  $\xi_{-1,+1} \geq 1$ .

Здесь заметим, что для узких зон (при  $\xi_{Z,Z'} = 1$  для  $Z, Z' = -1, 0, +1$ ) (13) переходит в (12), а в формулах для корней  $\lambda_i$  ( $i = 2, \dots, 5$ ) длины экранирования  $\Lambda_s$  и диффузии  $\Lambda_d$  разделяются. Для широких {1}- и {2}-зон дефектов ( $W_1 + W_2 > k_B T$  и  $\xi_{Z,Z'} > 1$ ;  $\xi_{-1,0} \neq \xi_{0,+1} \neq \xi_{-1,+1}$ ) в формулах для корней  $\lambda_i$  ( $i = 2, \dots, 5$ ) невозможно аналитически разделить длины экранирования  $\Lambda_s$  и диффузии  $\Lambda_d$ .

**Обсуждение результатов.** В дрейфово-диффузионном приближении составлена система линейных дифференциальных уравнений для описания прыжковой миграции как одиночных электронов, так и пар электронов по двухуровневым (трехзарядным) точечным дефектам одного сорта (вида) в кристаллическом полупроводнике. При решении этой системы рассмотрены частные случаи узких и широких зон (полос) уровней дефектов в запрещенной зоне (энергетической щели) полупроводника. Если энергетические ширины зон дефектов меньше тепловой энергии, то можно аналитически выделить выражения для длины экранирования внешнего стационарного электрического поля и длины диффузии электронов по дефектам, и они совпадают с полученными ранее [2; 6]. Если энергетические ширины зон дефектов больше тепловой энергии, то аналитически выделить длину экранирования внешнего стационарного электрического поля и длину диффузии электронов по дефектам невозможно.

Работа выполнена в рамках программы Республики Беларусь «Кристаллические и молекулярные структуры».

## Литература

1. Поклонский Н. А. // Междунар. зимняя школа по физике полупроводников 2011: Науч. прогр. и тез. докл., С.-Петербург – Зеленогорск, 25–28 февр. 2011 г. СПб., 2011. С. 43–48.

2. Поклонский Н. А., Вырко С. А., Забродский А. Г. // ФТП. 2008. Т. 42, № 12. С. 1420–1425.
3. Pollak M. // Phys. Status Solidi B. 2002. Vol. 230, N 1. P. 295–304.
4. Radiation effects in semiconductors / ed. by K. Iniewski. Boca Raton, 2011. – 420 p.
5. Брудный В. Н., Колин Н. Г., Смирнов Л. С. // ФТП. 2007. Т. 41, № 9. С. 1031–1040.
6. Поклонский Н. А., Лопатин С. Ю. // ФТТ. 1998. Т. 40, № 10. С. 1805–1809.
7. Poklonskii N. A., Stelmakh V. F., Tkachev V. D., Voitkov S. V. // Phys. Status Solidi B. 1978. Vol. 88, N 2. P. K165–K168.
8. Poklonski N. A., Vyrko S. A., Zabrodskii A. G. // Semicond. Sci. Technol. 2010. Vol. 25, N 8. P. 085006 (6 pp.).
9. Poklonski N. A., Vyrko S. A., Zabrodskii A. G. // Solid State Commun. 2009. Vol. 149, N 31–32. P. 1248–1253.
10. Poklonski N. A., Stelmakh V. F. // Phys. Status Solidi B. 1983. Vol. 117, N 1. P. 93–99.
11. Поклонский Н. А., Стельмах В. Ф., Ткачев В. Д. // Докл. АН БССР. 1976. Т. 20, № 9. С. 783–785.
12. Красинькова М. В., Мойжес Б. Я. // ФТП. 1990. Т. 24, № 11. С. 1934–1942.
13. Каширина Н. И., Лахно В. Д. // УФН. 2010. Т. 180, № 5. С. 449–473.
14. Бонч-Бруевич В. Л., Калашиников С. Г. Физика полупроводников. М., 1990. – 688 с.
15. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ижевск, 2000. – 368 с.
16. Manifacier J.-C., Henisch H. K. // J. Phys. Chem. Solids. 1980. Vol. 41, N 11. P. 1285–1288.

N. A. POKLONSKI, A. I. KOVALEV, S. A. VYRKO

poklonski@bsu.by

**DRIFT AND DIFFUSION OF ELECTRONS VIA TWO-LEVEL (TRIPLE-CHARGED)  
POINT DEFECTS IN CRYSTALLINE SEMICONDUCTORS**

**Summary**

In the drift-diffusion approximation, we considered the migration of both single electrons and pairs of electrons (bipolarons) due to their hops via immobile point defects of one kind in three charge states ( $-1$ ,  $0$ ,  $+1$ ) when an external electric field is applied to a semiconductor. We found the analytical expressions for the screening length of the stationary electric field and for the diffusion length of electrons hopping via such defects of the crystalline lattice.